

研究設備センター基盤部門 学内外共用設備紹介

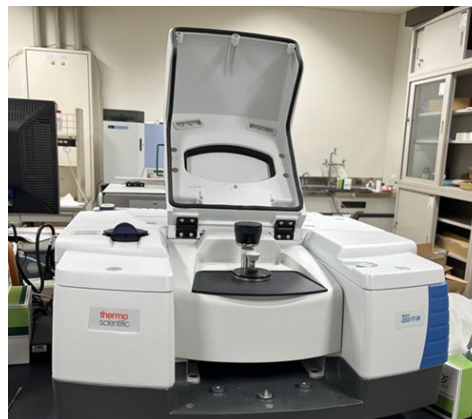
web page <https://www.arim.uec.ac.jp/>

問合せ先：arim@cia.uec.ac.jp

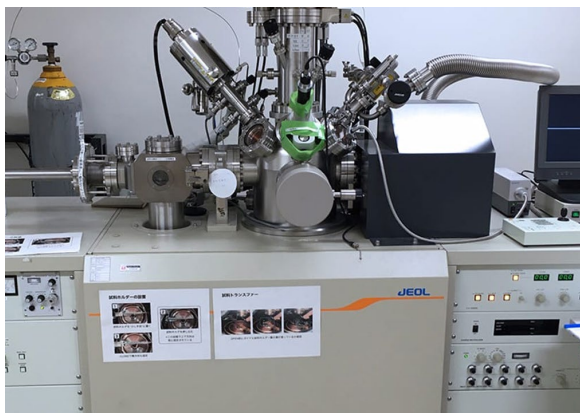


- ① ショットキー走査型電子顕微鏡 (101室)
 材料の表面構造を観察する装置。
 半導体、金属、セラミックスなどの微細な構造を観察して、新材料の開発などに用いられる。

- ◆ 公開日：令和7年6月25日（水）
- ◆ 場所：電通大東6号館1階
- ◆ 設備公開時間：
13:50～14:20、15:50～16:20



- ② フーリエ変換赤外分光計 (FT-IR) (149室)
 赤外線吸収特性を利用して物質の成分や構造を調べる装置
- 主な用途：
- 材料分析：ポリマーやゴムなどの成分分析
 - 品質管理：入荷・出荷原料の品質確認
 - 環境モニタリング：自動車や工場の排出ガスの測定
 - 異物・不良分析：製品の汚染物質や異物の特定
 - 薄膜・コーティング分析：表面処理や塗膜の評価



- ③ X線光電子分光法 (145室)
 材料の化学組成や表面状態を詳細に分析するための強力な分析装置
- 主な用途：
- 表面化学組成の解析
 - 薄膜・コーティングの分析
 - 表面改質の研究
 - エレクトロニクス材料の分析